# 开关式 MEMS 气流传感器 E501M 规格书

#### E501M 开关式 MEMS 气流传感器

版本: X1

日期:2024年7月18日

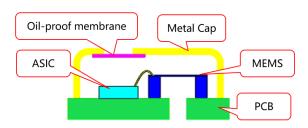
#### 目录

0.	产品简介	-1
1.	结构和尺寸	-1
2.	焊盘推荐设计	-2
3.	产品电气特性	-3
4.	应用电路	-4
5.	包装规格	-5
6.	回流焊曲线	-8
7.	规格书履历	-9

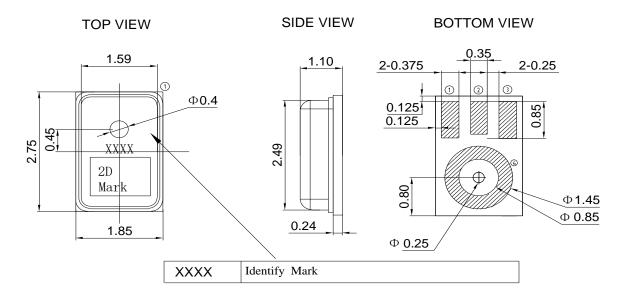
E501M	版本: X1
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

#### 0. 产品简介

E501M 是一款感应气流的传感器,其有两个孔,一个在金属壳上,用于接收负压,另一个在线路板上,连通大气,为参考零压点。该传感器的工作模式是当金属壳孔处的负压小于限定值时,输出高电平。该传感器具备超强的防油烟反吹能力。



#### 1. 结构和尺寸



Pir	Pin Output		
Pin#	Function		
1	Power		
2	Output		
3	Ground		
4	Ground		

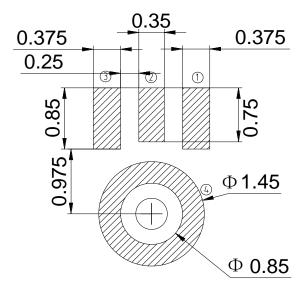
Item	Dim.	Tol.(+/-)	Units
*Length	2.75	0.100	mm
*Width	1.85	0.100	mm
*Height	1.10	0.100	mm
PCB PORT	0.25	0.05	mm
Cap PORT	0.40	0.05	mm

Note:(Tolerance +/-0.10mm unless otherwise specified)

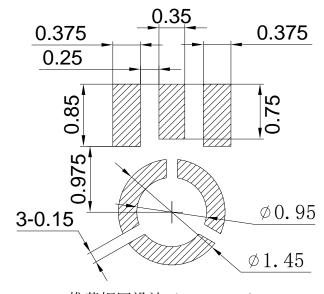
\* Stand for CTF

E501M	版本: <b>X1</b>
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

#### 2. 焊盘推荐设计:



建议 PCB 开孔尺寸: 0.50mm



推荐钢网设计(t=0.12mm)

# E501M 版本: X1 开关式 MEMS 气流传感器 日期:2024年7月18日

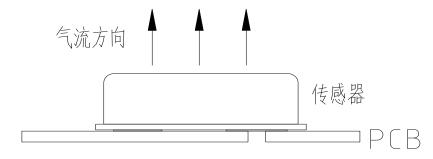
#### 3. 产品电气特性:

#### 测试条件: +25℃, 60-70%R.H.

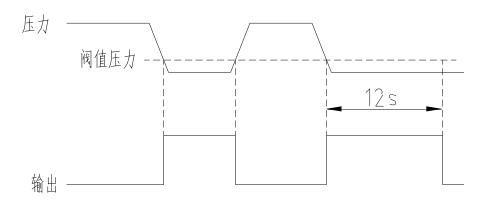
参数符号	符号	条件		规格		单位
			最小值	典型值	最大值	<del>中</del> 仏
电源输入	$V_{DD}$		2.5	3.7	5.5	V
电源电流	$I_{DD}$	Vdd=3.7V		3	5	uA
输出电压	V <sub>OH</sub>	吸烟状态	-	Vdd	-	V
开启压力			-160	-120	-80	Pa
保护时间			10	12	15	S

极限条件	符号	范围			* *
似限余件	47 <del>2</del>	最小值	典型值	最大值	単位
电源输入	V <sub>DD</sub>	-0.3		6.5	V
存储温度	T <sub>STG</sub>	-40		+150	$^{\circ}$
ESD (HBM)			4000		V

#### 安装示意图:



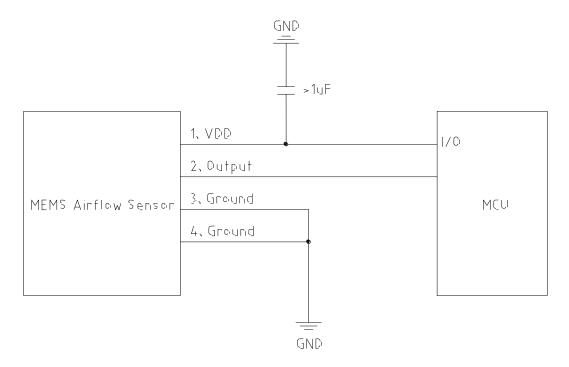
#### 工作模式图:



注: 超过保护时间,输出变为低电平

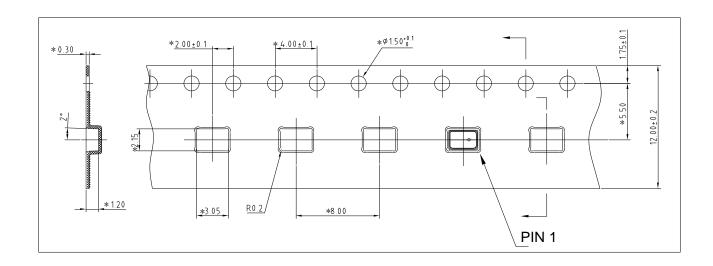
E501M	版本: <b>X1</b>
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

## 4. 应用电路



E501M	版本: <b>X1</b>
T. 子-P. RATERAC 与法从前限	
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

#### 5. 包装规格

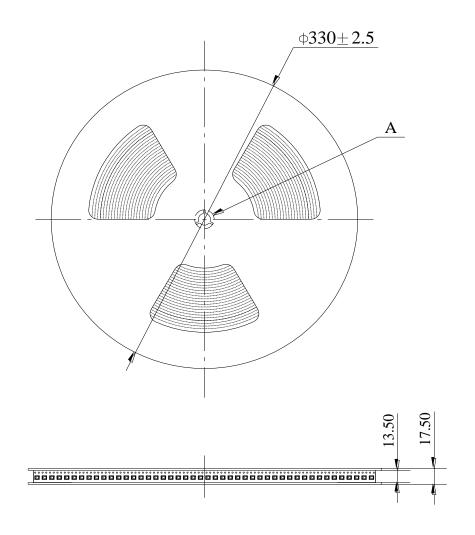


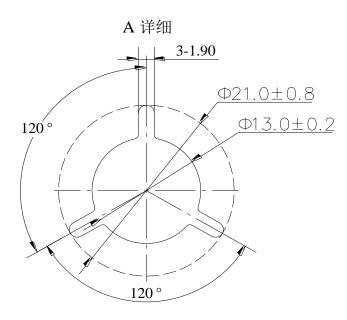
型号	卷盘直径	单卷数量
E501M	13 "	4500pcs

引导长度	卷带前端和尾部的部分应为空,长度 350~450mm。
标签	外包装和卷盘都要贴标签
空槽	没有连续的空置槽;每卷产品空置槽不超过3pcs。

E501M	
开关式 MEMS	气流传感器

日期:2024年7月18日



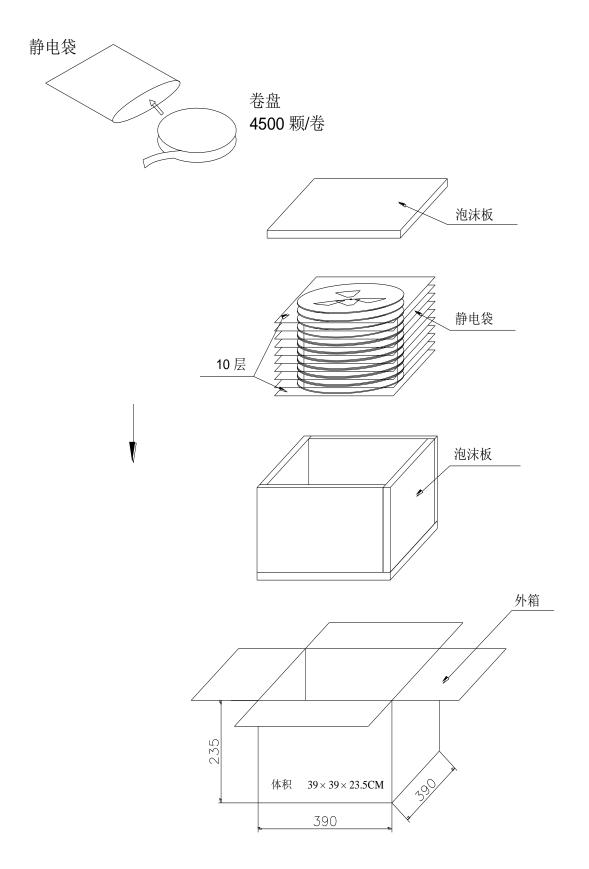


每卷4,500颗产品

E501M	
开关式 MEMS	气流传感器

版本: X1

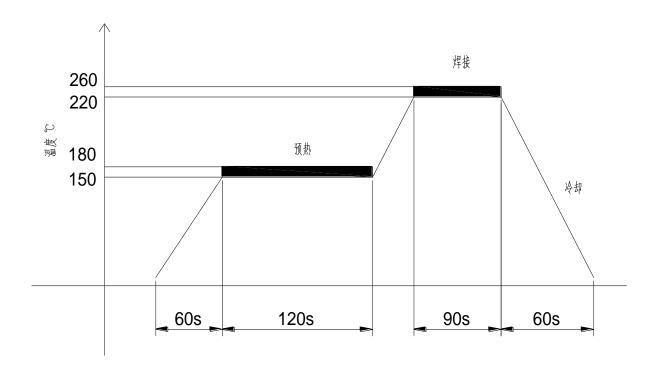
日期:2024年7月18日



每箱4,5000 颗产品

E501M	版本: <b>X1</b>
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

### 6. 回流焊



阶段	温度设置	时间(最大)
预热	150-180℃	120s.
焊接	大于 220℃	90s.
峰值	260℃	30s.

#### 注:

- 1. 回流焊之后不允许洗板,器件不允许经过超声处理或者超声清洁工序; .
- 2. 建议回流焊次数不超过3次。

E501M	版本: <b>X1</b>
开关式 MEMS 气流传感器	日期:2024年7月18日

# 7. 规格书履历

版本	拟定	审核	修改详情	日期
X1	李晋阳	张睿	初版	2024年7月18日